



# MERCURY<sup>®</sup> MP

先进的全自动批量喷淋清洗系统

先进的全自动批量喷淋清洗系统扩散前清洗，臭氧去胶及HF和BOE腐蚀后清洗。小而紧凑的尺寸，快速的工艺过程，安全的操作模式，很少的化学品消耗，特别是整合了我们的臭氧水发生器

### 特点及优点

- 大硅片容量
- 减少DI水消耗
- 节约化学品
- 低废液处理成本
- 高可靠的工艺稳定性
- 小的占地空间
- 安全的操作模式
- 可靠的操作模式

### 构造

- 6个6吋片架 \*\*
- 4个8吋片架 \*\*
- PLC控制
- 15吋触摸屏
- 高纯PFA气动阀
- 无金属沾污
- 在线式DI水加热
- 罐子控制箱
- HF和BOE循环槽
- 腔体温度检测

### Process availability

- B清洗
- C清洗
- RCA清洗
- SC1清洗
- SC2清洗
- SiO2腐蚀
- 臭氧清洗
- 过氧硫酸清洗
- 冲洗甩干

### 选项

- 计算机网络支持
- SECS II/GEM支持
- 臭氧水发生器，作为硫酸的可选项
- 红外线酸加热器
- 远程电话控制
- 简洁一体化版本 \*\*\*



\* 选项组件

\*\* 根据二手的转台构造

\*\*\* 从2014年一季度开始有新型号

## 喷淋系统

带臭氧水应用的先进的多合一的大容量湿法工艺设备

- 表面处理
- 可用于8吋硅片
- 臭氧水应用\*
- 6个化学品罐
- 成本优良
- 安全可靠
- 15吋触摸屏



Manufacturer of Equipment  
for the Semiconductor Industry

CSVG Group a.s.  
The Science and Technology Park  
of Palacký University in Olomouc  
Slechtitelu 21  
783 71 Olomouc  
Czech Republic  
E-Mail: martin.s@csvg.eu  
Telephone: +420 739 245 043